

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和7年1月27日(2025.1.27)

【公開番号】特開2023-134298(P2023-134298A)

【公開日】令和5年9月27日(2023.9.27)

【年通号数】公開公報(特許)2023-182

【出願番号】特願2022-39755(P2022-39755)

【国際特許分類】

H 01 L 21/52(2006.01)

10

H 01 L 21/60(2006.01)

【F I】

H 01 L 21/52 F

H 01 L 21/60 3 1 1 T

【手続補正書】

【提出日】令和7年1月17日(2025.1.17)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 5 5

20

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 5 5】

例えば、図7(b)に示すアタッチメント領域P<sub>0</sub>における補正係数をC<sub>a</sub>、図7(c)に示すアタッチメント領域P<sub>0</sub>における補正係数をC<sub>b</sub>とすると、C<sub>a</sub>、C<sub>b</sub>は下記の式(1)、(2)により算出される。ここで、C<sub>a</sub>は図5に示すアタッチメント領域P<sub>1</sub>の補正係数である。また、C<sub>b</sub>は図5に示すアタッチメント領域P<sub>3</sub>の補正係数である。

30

40

50